

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第7部門第2区分  
【発行日】平成19年4月12日(2007.4.12)

【公開番号】特開2006-324692(P2006-324692A)  
【公開日】平成18年11月30日(2006.11.30)  
【年通号数】公開・登録公報2006-047  
【出願番号】特願2006-218563(P2006-218563)  
【国際特許分類】

**H 0 1 L 21/683 (2006.01)**

【F I】

H 0 1 L 21/68 N

【手続補正書】  
【提出日】平成19年2月23日(2007.2.23)

【手続補正1】  
【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】全文  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項1】

チャック本体の外周に設けられたリムと、基板の裏面と該基板の裏面と対向する前記チャック本体の下内面と前記リムの内周側面とで囲むことによって空間を形成するように前記基板の外周を前記リムの上面に搭載した状態で前記基板の外周側面部を前記リムの上面に支持する支持手段と、前記形成された空間において前記チャック本体の下内面から前記基板の裏面に対してエアを吹きつけるエア供給手段と、前記形成された空間内の空気を排出するエア排出手段とを備える基板搭載装置を用いて前記基板を前記チャック本体に搭載し、前記基板に光を照射して該基板を検査することを特徴とする検査方法。

【請求項2】

チャック本体の外周に設けられたリムと、前記基板の外周を前記リムの上面に搭載した状態で前記基板の外周側面部を前記リムの上面に支持する支持手段と、該支持手段によって前記基板の外周側面部を前記リムの上面に支持した際、前記基板の裏面と該基板の裏面と対向する前記チャック本体の下内面と前記リムの内周側面とによって囲んで形成される空間と、該空間に対して所定量のエアを供給するエア供給手段と、前記空間内の空気を排出するエア排出手段とを備えた基板搭載装置を用いて前記基板を前記チャック本体に搭載し、前記基板に光を照射して該基板を検査することを特徴とする検査方法。

【請求項3】

前記基板搭載装置における前記エア排気手段は、前記リムの内周側面部及び前記チャック本体の下内面部の少なくとも一方に1つ又は複数設けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の検査方法。

【請求項4】

前記基板搭載装置において、前記チャック本体の下内面の中央付近に設けられ、前記リムの上面よりも低い平坦部を有する島状の複数のエアギャップ形成部と前記基板の裏面との間にエアギャップを形成し、前記エア供給手段は前記エアギャップ形成部に設けて構成することを特徴とする請求項1又は2に記載の検査方法。

【請求項5】

前記基板搭載装置において、前記リムの上面が前記チャック本体の中央に向かって傾斜して前記基板の外周側面部のみと接触するように構成されていることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一つに記載の検査方法。

**【請求項 6】**

前記基板搭載装置における前記支持手段が、前記リムの上面に回転自在に設けられ、前記基板の外周側面部に接触する接触部を備えた略長形状の板材からなるレバー部材と、前記レバー部材を前記リムに吸着する吸着口と、前記レバー部材が前記チャック本体から離れる方向に常時回転力を与えるパネ部材とを有して構成されることを特徴とする請求項 5 に記載の検査方法。

**【請求項 7】**

請求項 1 乃至 6 の何れか一つに記載の検査方法において、

前記リムは、基板の形状に沿ってチャック本体の外周に設けられ、前記空間内は所定の気圧に保持され、該基板が搭載されたチャック本体を回転させて前記基板の表面にレーザー光を照射して該基板の表面を検査することを特徴とする検査方法。

**【請求項 8】**

チャック本体の外周に設けられたリムと、基板の裏面と該基板の裏面と対向する前記チャック本体の下内面と前記リムの内周側面とで囲むことによって空間を形成するように前記基板の外周を前記リムの上面に搭載した状態で前記基板の外周側面部を前記リムの上面に支持する支持手段と、前記形成された空間において前記チャック本体の下内面から前記基板の裏面に対してエアを吹きつけるエア供給手段と、前記形成された空間内の空気を排出するエア排出手段とを備える基板搭載装置を設け、

前記基板に光を照射して該基板を検査するように構成したことを特徴とする検査装置。

**【請求項 9】**

チャック本体の外周に設けられたリムと、前記基板の外周を前記リムの上面に搭載した状態で前記基板の外周側面部を前記リムの上面に支持する支持手段と、該支持手段によって前記基板の外周側面部を前記リムの上面に支持した際、前記基板の裏面と該基板の裏面と対向する前記チャック本体の下内面と前記リムの内周側面とによって囲んで形成される空間と、該空間に対して所定量のエアを供給するエア供給手段と、前記空間内の空気を排出するエア排出手段とを備えた基板搭載装置を設け、

前記基板に光を照射して該基板を検査するように構成したことを特徴とする検査装置。

**【請求項 10】**

前記基板搭載装置における前記エア排気手段は、前記リムの内周側面部及び前記チャック本体の下内面部の少なくとも一方に 1 つ又は複数設けられていることを特徴とする請求項 8 又は 9 に記載の検査装置。

**【請求項 11】**

前記基板搭載装置において、前記チャック本体の下内面の中央付近に設けられ、前記リムの上面よりも低い平坦部を有する島状の複数のエアギャップ形成部と前記基板の裏面との間にエアギャップを形成し、前記エア供給手段は前記エアギャップ形成部に設けて構成することを特徴とする請求項 8 又は 9 に記載の検査装置。

**【請求項 12】**

前記基板搭載装置において、前記リムの上面が前記チャック本体の中央に向かって傾斜して前記基板の外周側面部のみと接触するように構成されていることを特徴とする請求項 8 乃至 11 の何れか一つに記載の検査装置。

**【請求項 13】**

前記基板搭載装置における前記支持手段が、前記リムの上面に回転自在に設けられ、前記基板の外周側面部に接触する接触部を備えた略長形状の板材からなるレバー部材と、前記レバー部材を前記リムに吸着する吸着口と、前記レバー部材が前記チャック本体から離れる方向に常時回転力を与えるパネ部材とを有して構成されることを特徴とする請求項 12 に記載の検査装置。

**【請求項 14】**

請求項 8 乃至 13 の何れか一つに記載の検査装置において、

前記リムは、基板の形状に沿ってチャック本体の外周に設けられ、前記空間内は所定の気圧に保持され、該基板が搭載されたチャック本体を回転させて前記基板の表面にレーザ

光を照射して該基板の表面を検査するように構成したことを特徴とする検査装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】検査方法および検査装置